SEMICONDUCTOR LASER LIGHT SOURCE DEVICE

Patent number:

JP60117695

Publication date:

1985-06-25

Inventor:

TAKIGUCHI HARUHISA; others: 03

Applicant:

SHARP KK

Classification:

- international:

H01S3/18; H01S3/096

- european:

Application number:

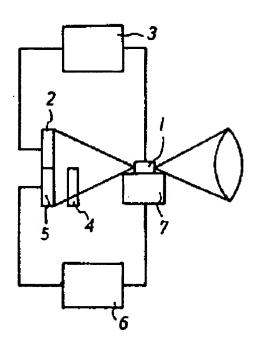
JP19830227292 19831129

Priority number(s):

Abstract of JP60117695

PURPOSE:To obtain easily a laser light source, in which the change of oscillation wavelength is very small, by a method wherein the output of a semiconductor laser is controlled constantly by a light detector, and the oscillation wave length of the semiconductor laser is made constant by an interference filter, a light detector and a Peltier element.

CONSTITUTION:Light is radiated from both end surface of the semiconductor laser of the type of a Fabry-Perot resonant device, and the light from one side is used as the light source. A part of the light which is radiated from another end surface of the resonant device directly shines into a light detector 2 for controlling the driving electric current, and the remnant part of the light shines into the light detector 5 for controlling the oscillation wave length after passing through an interference filter. The light volume which entered the light detector 2 is transformed to the electric signal, and is introduced to a constant output circuit 3 which is the circuit to supply the driving current to the semiconductor laser 1. The electric signal from the light detector 2 becomes the feedback signal to make the output of the semiconductor laser 1 constant. The light entered in the light detector 5 is transformed to the electric signal, and is inputted to a Peltier element driving circuit 6, and the output from said circuit 6 is inputted to a Peltier element 7 connected to the semiconductor laser 1.



Data supplied from the esp@cenet database - Worldwide

BEST AVALABLE COPY

個日本国特許庁(JP)

⑪特許出鰕公開

四公開特許公報(A) 昭60-117695

60Int,Cl,4

識別配号

庁内整理番号

母公開 昭和60年(1985)6月25日

H 01 S

3/096

7377-5F 7377-5F

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

❷発明の名称 半導体レーザ光源装置

> 创特 顧 昭58-227292

顧 昭58(1983)11月29日 の出

砂発 眀 治 久 倒器 明 松 井 完 益 者 伊発 明 兼 岩 進 治 元隆 伊新 明 渚 谷

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内 大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社内

初田 顧 人 シャープ株式会社 大阪市阿倍野区長池町22番22号

·外2名

の代理 人 弁理士 福士 愛彦

1. 発明の名称 半導体レーザ光源装置

2 特許請求の範囲

- 1 半導体シーザの出力光を波長に対応して透過 させる干渉フィルタと、該干渉フィルタ透過光 量を検出する光検出器と、数光検出器の出力に 応答して態度制御されるペルチェ素子とを具備 して成り、前記半導体レーザの出力光波長に対 応して前配ペルチェ素子を加熱冷却させること により前記半導体レーザの温度制御を行なうよ りにしたことを特徴とする半導体レーザ光源装
- 2 煎配半導体レーザが出力光強度を検出して出 力光を一定に保持する定出力駆動回路で駆動制 御されている特許請求の範囲第1項記載の半導 休レーザ光速袋置。
- 3. 発明の詳細な説明

<技術分野>

本発明は、放長制御型半導体レーザを用いた尤

演歩優に関するものである。

<従来技術>

近時、光を用いた計測技術の発達化伴い、波長 を姓体とした計測技術が重要視されるようになっ てきた。波長を維休とした計測技術で必要とされ るものに、波長を安定化した半導体レーザがある。 通常の半導体レーザ装置では周囲温度等の変化に よる発掘波長の変動が大きく、定破長出力光源と して使用するのは困難である。従って上述の波及 を安定化した光源としては、DBR (Distributed Brgg Reflection)型(ブラック反射型) レーザやDFB (Distributed Feed Back)型(分布帰還型)レーザ等の囮折格子を 利用して放長を決定する構造のものが用いられる。 しかしながら、これらの半導体レーザ素子は、そ の構造が複雑であり、一定ピッチの細かい回折格 子を活性領域に連設して形成する必要上製作も困 酸となり、歩留りが悪く非常に高値なものになる という問題点がある。

<発明の目的>

BEST AVAILABLE COPY

本発明は上述の問題点に鍛みてなされたもので、 比較的簡単な構造の半導体レーザを用いた波長の 安定な光爆袋量を提供することを目的とする。 <実施例>

第1回は本発明の一実施例を示す光源装置の概 路構成図である。1は通常のファブリベロー共振 器型の半導体レーザで、共振器の両端面より出射 された光のうち、一方が光切として使用される。 また、他方の共扱器媼面より出射された光の一部 は駆動電流を制御するための光検出器2に直接入 射され、残りの一部は干渉フィルタ4を通過した のち発掘波長を制御するための光検出器 5 に入射 される。光検出器2亿入射した光の光量は電気値 号に変換され、定出力回路 3 に導びかれる。定出 力回路3は半導体レーザ1に駆動電流を供給する 団路3であり、光検出器2からの電気信号は半導 体レーザ1の出力を一定にするための帰還信号と なる。光検出器 5.に入射した光は電気信号に変換 され、ベルチェ素子級動回路 8 に入力される。ペ ルチュ素子駆動回路6からの出力は半導体レーザ

と、周囲風度Tの変化等で発振波長が変化すると 干渉フィルタ4を通過する光量が大きく変化し、 従って発振波長の変化を光検出器5への入射光量 の変化を光検出器5への入射光量 の変化を光検出器5への入射光量 の変化を光検出器5への入射光量 の変化を光検出器5へのとができる。と れをペルェ素子駆動回路6に帰還することにより、 ペルチェ素子駆動回路6からの出力で光検出器5 の入射光量が一定となるように、即ち半導体レーザ1の発振波長が一定となるようにベルチェ素子 で変化を割倒することができる。ベルチェ素子では電流に応答 して発熱冷却を割倒することができる。 半導体レーザ1を搭載したステムに直結されている。 がってベルチェ素子駆動回路6からの出力に よりステムの加熱冷却を制御することができる。

以上要約すると光検出器2によって半導体レーザ1の出力光を一定に制御し、干渉フィルタ4、 光検出器5及びベルチェ素子7により半導体レーザ1の発振波長を一定とすることができる。第1 図に示すレーザ光源装置の周囲温度を0でから 50で遊変化させたところ、半導体レーザ1の発 1 に追納されたベルチェ素子?に入力される。

次に、干砂フィルタ4の遺過特性と半導体レー ザ1の波長 4 の関係を第2図に示す。第2図に示 す例では、半導体レーザ1をAlGaAs 系レーザ ダイオードとし、波長よが塩温25cで7800Å となるようにレーー ザ素子を製作した。干渉フィルタ ー4としてはSiOェ/TiO。 系をフィルタ用材 料として選定し、被長7800Åで透過率の変化 が個大から個小へ最も急峻となる短波長済過フィ ルメを設計製作した。膜厚精度を1%として50 層の上記フィルタ用材料薄膜を積層した多層膜を 連続して電子線蒸着したところ、 1 < 7 8 0 0 Å では透過率が100%に近く1>8000Åでは 透過串が0%に近い第2図に示す様左透過特性を 有する干砂フィルタが得られた。との干砂フィル タ4に半導体レーザ1の出力光を照射すると波長 7800Åでの透過率の温度変化^{Δ T}/_{△ ↓ は、} ΔT/A, = 85%/å であった。

このように波長に対する透過率の変化の大きい となるに、半導体レーザ1の発振波長を設定する

扱波長の変化は2Å以下であった。 <発明の効果>

以上、評述したように、本発明によれば、発機
被長の変化が極めて小さいレーザ光源を容易に得
ることができ、特に計削技術や通信技術分野での
利用価値は極めて大きい。尚、上記実施例では、
半導体レーザの材料としてGaAlAs 系を用いたが、これはInGaAsP 系等の4元系やその他の
材料によっても同様な半導体レーザ装置を構成することができる。また、干渉フィルタの材料も、
SiO:/TiO:系に限定されるものではなく、
Al:Oa.Bs:Os.YiOa.Ta:Os その他種々の
材料を用いることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明の1実施例を示す半導体レー ザ光原装置の構成図である。

第2図は第1回に示す干渉フィルタの透過率の 波景奴存性と、半導体レーザの発提放長(重電 2 がで)を示す説明図である。

1…半導体レーザ、2…光検出器、

3…定出力回路、 4…干渉フィルタ、

5 … 光検出器、 6 ….ペルチェ素子駆動回路.

7 …ペルチェ素子。

代理人 弁理士 福 士 愛・彦(他2名)

